

- 이름 : 염근영
- 소속 : 신소재공학부
- 연구분야 : 플라즈마

## 플라즈마 발생장치 및 이를 포함하는 기판 처리 장치 (10-1914902)

### 상품 개요

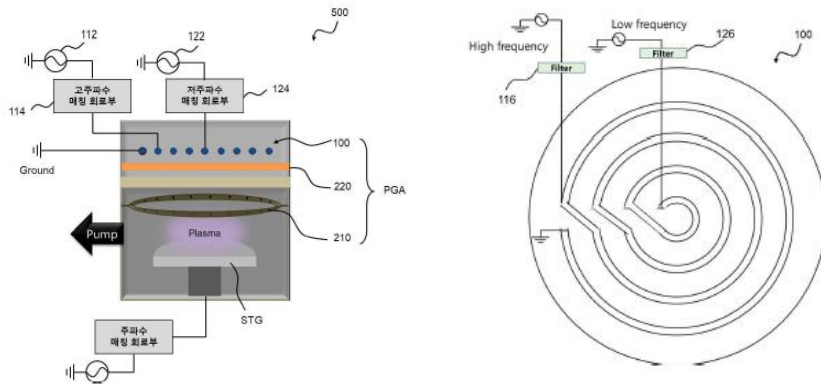
단일 코일에 서로 다른 주파수를 인가하더라도 저주파수에 충분한 인덕턴스를 확보할 수 있도록 하여 광범위한 주파수 조절을 가능하게 함으로써 안정적으로 플라즈마를 생성하는 동시에, 균일한 전압(power) 배분을 통해 플라즈마의 균일성 또한 향상시킬 수 있는, 플라즈마 발생 장치를 제공함.

### 개발 현황

- 광범위한 주파수 조절 가능함으로써 안정적인 플라즈마 발생장치 설계
- 균일한 전압 배분을 통해 플라즈마 균일성 향상

### 기술 상품 소개

- 단일코일형 플라즈마 소스에 서로 다른 주파수 인가
- 고주파 전력 및 저주파 전력 인가
- 단일 코일의 제1 단부만 접지



### 기술완성도



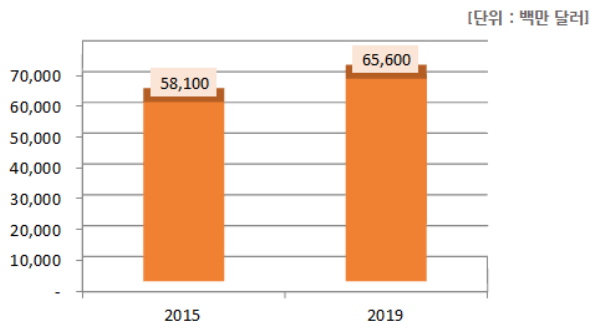
TRL7:

## 시장적용분야

- 표면처리
- 플라즈마 공정
- 이온빔 식각

## 상품시장정보

- 플라즈마 표면처리 세계시장은 2010년 98조 원에서 2016년에는 110조 원에 달할 것으로 전망되며 연평균 24%의 성장률을 보일 것으로 예측
- 국내 시장은 연평균 10.5%의 높은 성장률에 힘입어 2015년 현재 6.74조 원에서 2016년에는 11조 원에 달할 것으로 전망



자료 : (사)한국전자회로산업협회 PCB BRIEFING(2015), 델타텍 재구성

[플라즈마 반도체웨이퍼 공정 시장 전망]

## 상품 추가정보

-출원인: 성균관대학교 산학협력단

-주 발명자: 염근영

-패밀리 특허

패밀리 특허 현황	US2019-275523 외 1건
패밀리 국가	US
판매금액	가격 협상

## 권리사항

No	특허명	특허번호
1	플라즈마 발생장치 및 이를 포함하는 기판처리장치	10-1914902

문의처 

특허법인 현문 박지호 변리사

Tel : 02- 553-2208 | Email : jhp@hmip.kr